

펄스형 방전플라스마에서 발생하는 가시광선의 분광(Ⅱ)

최운상 · 정수자 · 김용훈 · 장준규 · 정정복 · 신장철

부산여자대학 안경광학과

펄스형 방전플라스마 발생장치인 플라스마 포커스장치에서 발생하는 가시광선영역의 빛을 시간적분 분석법으로 분광 분석하였다. 플라스마 포커스장치는 펄스방전에 의해 전기에너지를 빛에너지로 발생시킬 수 있는 장치이다. 분광분석기는 초점거리가 0.5m인 모노크로메터를 사용하였다. 시간적분 분석법은 분광된 일정한 범위의 가시광선영역의 과장대를 필름에 현상하여 densitometer로 분석하는 방법이다. 가시광선 발생은 방전전압과 기체압력의 최적조건에서 발생되었는데 방전전압은 13kV이고 아르곤과 헬륨기체가 가시광선영역의 빛을 발생시키는데 사용되었다.

Spectroscopy of visible light emitted from plasma occurred by pulse discharge(Ⅱ)

Woon Sang Choi · Soo Ja Jung · Yong Hun Kim

Jun Kyu Jang · Jung Bok Jung · Jang Cheol Shin

Department of Ocular Optics, Pusan Women's College

We investigated visible light radiated from Plasma Focus device by time-integrated analyzed method. Plasma focus is a device that translates electric energy into visible light by electric discharge. Spectral analysis is using Monochromator(focal length = 0.5 m). Time-integrated spectrum is analyzed with densitometer the film which developed a constant range of wavelength. The condition of visible emission was that the discharging voltage was 13 kV and the working gas were Argon and Helium.

I | 서 론

플라스마 상태에서 방사하는 가시광선은 가시광선 모든 파장영역(400 nm ~ 700 nm)에 걸쳐 연속 스펙트럼과 특정 선스펙트럼으로 방출되며 광선의 세기(Intensity) 또한 플라스마 상태유지를 위한 외부 변수로서 조절할 수 있어 광원의 원천으로서 용용되고 있다.

플라스마 상태는 에너지가 높은 이온화 된 물질의 상태로서 형광등과 같이 연속으로 빛을 방사할 수 있는 낮은 에너지의 상태와 번개처럼 순간적(pulse : millisecond

이하의 시간)으로 빛을 방사하는 높은 에너지의 상태로 나눌 수 있다. 플라스마에서 방출(emission)하는 빛은 마이크로 파에서부터 X-선 영역까지 전자기파의 전 파장 영역에 걸쳐서 방사하며 이러한 플라스마원천은 광의 원천으로서 의학용이나 산업용으로 널리 이용되고 있다.^[1, 2]

펄스형 고온플라스마장치는 플라스마의 발생방법이 대부분 전기에너지를 이용한다. 전기에너지를 축전기에 저장시켰다가 이것을 펄스형 방전스위치로서 방전관내의 기체에 방전시키는 것으로 이 때 순간적으로 플라스마가 발생하며 발생된 플라스마 입자의 상호작용에 의해 전자기파의 방사가 있게 된다. 높은 세기의 빛을 얻기 위한

방법으로 고전압의 사용이 우선 이지만 이외에도 방전관 내의 기체 종류 및 기체 압력 또한 높은 세기의 빛과 필요로 하는 파장대의 빛 방사에 변수가 되기 때문에 적절한 기체사용과 방전전압의 변화에 따른 방사광의 특성 연구가 필요로 한다.

본 연구는 펄스형 플라즈마 포커스(Plasma Focus)장치에서 아르곤과 헬륨 기체를 각각 방전시켰을 때 방출되는 광방사 현상을 근자외선 영역과 가시광선 영역에 대해 분광분석장치를 사용하여 분석하였다. 분광분석법은 시간적분 스펙트럼 분석법(time-integrated spectrum method)을 사용하였다.

II | 실험장치 및 방법

플라즈마 포커스장치의 전압은 최대 40 kV까지 공급할 수 있다. 이 장치는 두 개의 구리전극이 있으며 전극사이에 세라믹 절연체로 절연되어 있다. 포커스장치의 방전시 방전기체로는 불활성기체로서 파장대가 알려져 있어 파장의 추적이 쉬운 아르곤(Ar) 기체와 헬륨(He)기체를 각각 사용했다. 기체는 진공용기의 압력을 기본진공영역(10^{-6} torr)까지 진공펌프(Varian VHS-4)로 낮춘 후 실험 압력까지 충전시켰다.

플라즈마 포커스장치의 진공용기는 옆면에 창이 있어 이곳을 주름관으로 모노크로메터(monochromator)와 연결하여 방출되는 광선을 모노크로메터로 보냈으며 이 방법은 또한 외부의 노이즈를 감소시킬 수 있었다. 모노크로메터는 Czerny-Turner mounting spectrometer ($f = 0.5$ m)를 사용하여 1200 g/mm의 grating으로 분광시켰다.

측정을 위한 구성은 그림 1과 같다. 본 연구에서 사용된 시간적분 스펙트럼 분석법은 측정될 수 있는 파장범위 내에서 스펙트럼세기의 파장의존성을 측정하는 방법으로서 본 측정에서는 충전기체종류, 기압 및 방전전압 등의 의존성을 조사하여 고감도 film에 감광시킨 후 optical densitometer(Toyo, DMU 33-C)로 분석하였다. 사용한 필름은 T-max 3200(Kodak Co.)이고 수은 스펙트럼을 이용하여 파장을 보정하였으나 파장의 함수로 film의 감광도는 보정할 수 없었다.^[3]

장치의 방전전압은 13 kV 근처의 전압이 장치의 수명과 안전을 고려했을 때 적절한 것으로 예비 실험을 통해 알 수 있었으며, 기체압력은 두 기체에 대해 0.5 torr에서 실험되었다.

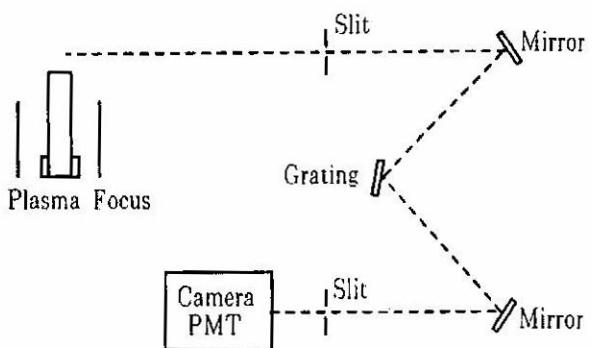


Fig. 1. Schematic diagram of Plasma Focus Device and Monochromator using as detector of light pulse.

III | 결과 및 고찰

스펙트럼의 특성을 충전기체(Ar, He)를 변수로 하여 측정하였다. Near UV-visible-near IR 스펙트럼의 전반적인 세기를 알기 위해서 파장의 범위를 1200 Å에서 12000 Å 까지 그리고 Ar, He 기체에 대해 스펙트럼을 관찰하였으나 감광필름의 sensitivity가 6000 Å 이상에서 현저히 감소하는 특성을 감안하여 1200 Å ~ 5800 Å 파장범위에서 스펙트럼을 분석하였다.^[3]

그림 2는 1200 Å ~ 5800 Å 범위에서 Ar과 He 기체를 충전시켰을 때 이 장치에서 방출하는 빛의 스펙트럼에 대한 densitometry 분석이다. 각각은 기압이 0.5 torr, 방전전압 13 kV에서의 분광특성결과로 두 기체가 모두 2000 Å ~ 4000 Å 파장범위에서 연속스펙트럼의 세기가 강하게 나타나고 있으며 다른 범위에서는 선스펙트럼들만이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이것은 플라즈마포커스 장치에서의 광방사가 UV-visible-IR의 전영역에 걸쳐 있으며 특히 near UV 영역의 빛의 방사가 강하다는 것을 알 수 있다. 그림 2에서는 각 기체의 특성 선스펙트럼인 Ar(3765 Å, 4190 Å, 4200 Å, 4426 Å, 4579 Å), He(1640 Å, 2577 Å, 3889 Å, 4471 Å)의 스펙트럼을 관찰할 수 있다. 또한 전극의 재질인 Cu선 스펙트럼(2961 Å, 3248 Å, 3274 Å, 4023 Å, 4063 Å)과 여러 불순물 선 스펙트럼도 공통적으로 관찰되는데 Cu선들은 전극인 구리에서 증발되어 나온 것으로 볼 수 있고 Si선 스펙트럼(5041 Å, 5056 Å)은 절연체로 사용된 세라믹에 함유된 것으로 플라즈마 포커스의 방전초기 단계에서 방출된 것으로 볼 수 있다.

스펙트럼에서 두 기체는 2800 Å과 3700 Å에서 최대 세기를 가지는 연속스펙트럼이 형성되어 있다. 연속스펙트

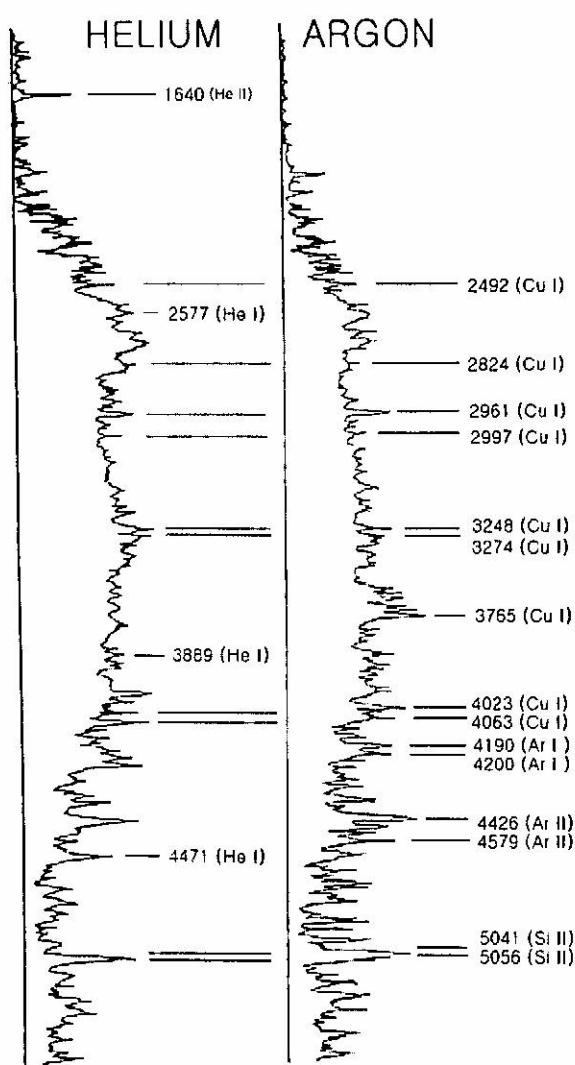


Fig. 2. Spectral characteristics of Ar and He gas in the Plasma Focus.

럼은 흑체복사 곡선(Black body radiation curve)으로 볼 수 있으며 다음과 같은 Wien의 변위법칙(Wien's displacement law)으로 복사체의 온도를 계산할 수 있다.^[4]

$$\lambda_{\max} T = 2.8970 \times 10^3 mK \dots \dots \dots \quad (1)$$

여기서 λ 는 미터단위의 파장을 나타내며 λ_{mar} 는 연속스펙트럼에서 최대의 세기를 가지는 위치의 파장이다. T는 온도이며 단위는 켈빈이다. 최대세기를 가지는 2800\AA 과 3700\AA 파장에서 (1) 식을 이용하여 온도를 계산하면 10346 K 와 7830 K 를 얻을 수 있다. 즉, 이러한 고온에서 플라스마 입자들의 반응에 의해 가시광선영역의 빛이 방출되었다.

IV 결 론

펄스형 방전장치인 플라스마 포커스장치에서 방출되는 가시광선의 분광특성을 조사하였다. 이 장치에서는 연속스펙트럼과 선스펙트럼이 각 파장영역에서 나타났다. 선스펙트럼은 반응하는 기체와 구리전극 및 절연체에서 각각 방출된 광선에 의해 나타났다. 연속스펙트럼은 2000~4000Å사이에서 강한 스펙트럼이 나왔으며 최대 세기를 가지는 파장대로부터 온도를 크기를 확산하면 스펙트럼의 방출온도는 10000K가 된다.

참고문헌

- [1] F. F. Chen. Introduction to plasma physics and controlled fusion. Plenum press. New York. (1984).
 - [2] 박덕규. 플라즈마 및 핵융합물리학. 형설출판사. (1985).
 - [3] Kodak T-Max Professional Films Information. Eastman Kodak Co. Rochester. (1989).
 - [4] "Fundamentals of Optics. 4th ed." McGraw-Hill. F. A. Jenkins and H. E. White, 1976